

Mikrointerferometer MII-4



Das Mikrointerferometer MII-4 ist ein berührungsloses optisches Instrument, um die Rauheit der polierten Oberflächen und deren Veredelung, sowie die Schichtdicke zu messen (Höhe, welche von der Kante der Schicht und dem Substrat gebildet wird). Interferenzmuster können in weißem und monochromatischem Licht beobachtet, sowie Fotos mit der Film-Kamera, die einen Teil der Vorrichtung ist, angefertigt werden. Das Mikrointerferometer ermöglicht Messungen mit der Mikrometerschraube MOU oder dem photoelektrischen Okularmikrometer FOM zur automatischen Verarbeitung der Messergebnisse. Mit dem Mikrointerferometer und dem photoelektrischen Okularmikrometer kann man die Genauigkeit der Messung der Rauheit 2 Mal verbessern und die Ermüdung des Bedieners erheblich reduzieren. Das Mikrointerferometer wird in der Maschinenindustrie und in den Labors der Forschungseinrichtungen verwendet, die sich mit hochwertigen Oberflächen beschäftigen.

Technisches Mikrointerferometer MII-4:

Messbereich Rmax und Rz und Schichtdicke, μ	0,1 - 0,8
Vergrößerung der visuellen Beobachtung	500
Lineares Sichtfeld in dem Objekt, mm	0,3
Abmessungen, mm	300x300x420
Gewicht, kg	30